

EV Group Launches Next-Generation EVG150 Resist Processing Platform – November 13, 2022

EV그룹, 차세대 EVG150 레지스트 처리 플랫폼 출시

- 김종율 기자
- 승인 2022.11.14 11:29
-



EV Group(이하 EVG)이 차세대 200mm 제품으로 EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템을 출시한다. EVG150 플랫폼은 이전 세대 플랫폼과 비교할 때 최대 80퍼센트까지 더 높은 생산성, 우수한 범용성, 50퍼센트 더 작은 풋프린트가 특징이다.

이 제품은 범용 플랫폼으로서 신뢰할 수 있는 고품질 코팅 및 현상 공정을 가능하게 하므로, 첨단 패키징, MEMS, RF, 3D 센싱, 전력 반도체, 포토닉스를 비롯한 다양한 디바이스 및 애플리케이션에 적용된다. 더불어 우수한 생산성과 유연성 및 반복성을 통해 대량 생산과 산업용 개발 양쪽 모두의 까다로운 요구를 충족한다.

200mm 기판용 차세대 EVG150은 이전 세대 플랫폼의 업계 선도적인 특성을 그대로 유지하고 있다.

이러한 특성으로는 회전 및 분사 코팅, 현상, 베이킹 및 냉각 공정을 위해 맞춤형 모듈 구성이 가능한 자동화된 플랫폼, 극히 복잡한 형태의 컨포멀 코팅이 가능한 EVG 고유의 OmniSpray 기술, 지속적으로 높은 생산성을 달성하도록 듀얼 엔드 이펙터 기능을 사용하는 정교하고 성능이 검증된 로봇 핸들링, 그리고 웨이퍼 에지 핸들링과 휘거나 뒤틀린 웨이퍼, 또는 박막 웨이퍼를 취급할 수 있는 능력이 포함된다.

저작권자 © MSD(Motion System Design) 무단전재 및 재배포 금지

출처 : MSD(Motion System Design)(<http://www.msdkr.com>)

<http://www.msdkr.com/news/articleView.html?idxno=11723>